

3 том. 5 секция ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ВЛИЯНИЕ АНИОННОГО ДОПИРОВАНИЯ (F⁻, Cl⁻) НА ХИМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОТОННЫХ ПРОВОДНИКОВ С ПЕРОВСКИТОПОДОБНОЙ СТРУКТУРОЙ

Тарасова Н.А., Галишева А.О., Толстыкина А.А., Анимица И.Е.

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, e-mail: Natalia.Tarasova@urfu.ru

Разработка материала, пригодного для использования в качестве электролита твердооксидного топливного элемента является одной из актуальных задач современного материаловедения. Материалы такого типа должны обладать высокой проводимостью в среднетемпературном диапазоне, а также быть устойчивыми в окислительных и восстановительных атмосферах.

Наиболее изученными в данной области являются материалы на основе цератов и цирконатов щелочноземельных металлов. Так, церат бария $BaCeO_3$ показывает достаточно высокие значения электропроводности, но при этом деградирует в атмосфере CO_3 .

Для оптимизации свойств материалов часто используют методы допирования. Наиболее распространенным является допирование катионной подрешетки Однако, существует другой метод улучшения физико-химических свойств – анионное допирование, то есть замещение ионов О²- на ионы иного радиуса или валентности.

В рамках настоящего исследования методом твердофазного синтеза получены галогензамещенные составы на основе сложных оксидов со структурой перовскита и производной от нее $Ba_2In_2O_5$, $Ba_4In_2Zr_2O_{11}$ и $Ba_4Ca_2Nb_2O_{11}$, проведена их рентгенографическая аттестация. Выполнено исследование химической устойчивости полученных галогензамещенных сложных оксидов к парам воды и углекислому газу. Установлено, что F^- - и Cl^- - содержащие образцы являются более химически устойчивыми по сравнению с недопированными составами, что позволяет сделать вывод о том, что введение фторид- и хлорид-ионов в анионную подрешетку способствует увеличению химической устойчивости кислороддефицитных сложных оксидов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект 18-73-00006